

各 位

会 社 名 株 式 会 社 P A L T E K
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 吹 尚 秀
(J A S D A Q コード 7587)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 オ ペ レ ー シ ョ ナ ル 井 上 博 樹
サ ー ビ ス デ ィ ビ ジ ョ ン 本 部 長
T E L 0 4 5 - 4 7 7 - 2 0 0 0

新会社設立及び事業譲受に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 24 日開催の取締役会において、サイミックス株式会社より半導体事業及び MEMS 事業について、新たに設立した株式会社テクノロジー・イノベーションにて事業譲受を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 事業譲受の目的

当社グループはエレクトロニクスメーカーに対して、多様な文化のもとで生まれる技術や製品を提案・提供することで、お客様の発展に努めております。このたび、当社グループはセンサー及び MEMS (※) に関するソリューションを強化すべく、サイミックス株式会社より半導体事業及び MEMS 事業を譲り受けることを決定いたしました。同事業を推進するにあたっては、新たに株式会社テクノロジー・イノベーションを設立し、同社が事業を譲り受けることとなります。

今回譲り受ける半導体事業では、人感センサーなどに搭載される高性能な信号処理 IC の開発を行っており、センサーに関するモジュールや機器を開発するお客様に提供いたします。また、MEMS 事業では MEMS 技術を応用することでモジュールなどの小型・超薄型パッケージの開発・量産化を実現し、お客様製品の高付加価値化、コスト低減などを実現いたします。センサー市場は、世界市場において 2020 年には 2011 年比で 38% 増加することが見込まれている今後の成長が期待できる市場です。当社グループはセンサーに関する信号処理 IC を、モジュールや機器を開発するお客様に提供することで、業績の向上を図ってまいります。

(※) MEMS (メムス、Micro Electro Mechanical Systems) とは、微小な電気機械システムという意味で、半導体製造技術やレーザー加工技術等、各種の微細加工技術を応用し、微小な電気要素と機械要素を一つの基板上に組み込んだデバイス/システム (センサー、アクチュエータ等) のこと。各種の最終製品に組み込まれ高付加価値化のキーデバイスとなっており、最近では産業のマメと言われている。

2. 新会社の概要

(1) 名 称	株式会社テクノロジー・イノベーション
(2) 所 在 地	長野県塩尻市大字大門字桔梗ヶ原 57-9
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 矢吹 尚秀
(4) 事 業 内 容	センサー用信号処理 IC 及び MEMS 製品の設計、開発、製造 (ファブレス) 及び販売
(5) 資 本 金	30,000 千円
(6) 設 立 年 月 日	平成 26 年 6 月 10 日
(7) 大株主及び持株比率	株式会社 P A L T E K 100.00%

3. 譲渡会社の概要

(1) 名 称	サイミックス株式会社	
(2) 所 在 地	長野県茅野市ちの 3443-7	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 吉川 久男	
(4) 事 業 内 容	集積回路・半導体素子・表示デバイス及びその他の電子部品・機器等の販売 ソフトウェア開発及び電子機器の開発・設計	
(5) 資 本 金	78,400 千円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 24 年 7 月 2 日	
(7) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 日程

(1) 新 会 社 設 立 日	平成 26 年 6 月 10 日
(2) 事業譲渡契約締結日	平成 26 年 6 月 24 日
(3) 譲 受 日	平成 26 年 6 月 30 日 (予定)

5. 今後の見通し

本件による平成 26 年 12 月期連結業績への影響は軽微です。今後の見通しに変更が生じた場合には速やかに報告いたします。

以 上